

NRTW 2025

National Reliability Technology Workshop

Mercredi 19 et Jeudi 20 mars 2025 | GANIL – Bd Henri Becquerel, 14000 Caen

Effets des radiations sur les composants et systèmes électroniques embarqués: Des applications spatiales aux applications terrestres, tous concernés.

Françoise BEZERRA

CNES

Organisé par :



SOMMAIRE

01

CONTEXTE
Environnement Radiatif Naturel

02

INTRODUCTION
Interactions rayonnements/matière

03

EFFETS CUMULATIFS
Effets de dose

04

EFFETS SINGULIERS
Probabilistes

05

EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Impact sur la sensibilité à l'ERN

06

CONCLUSION
Quels effets redouter et moyens d'essais

01

CONTEXTE

ENVIRONNEMENT RADIATIF NATUREL

ENVIRONNEMENT RADIATIF SPATIAL

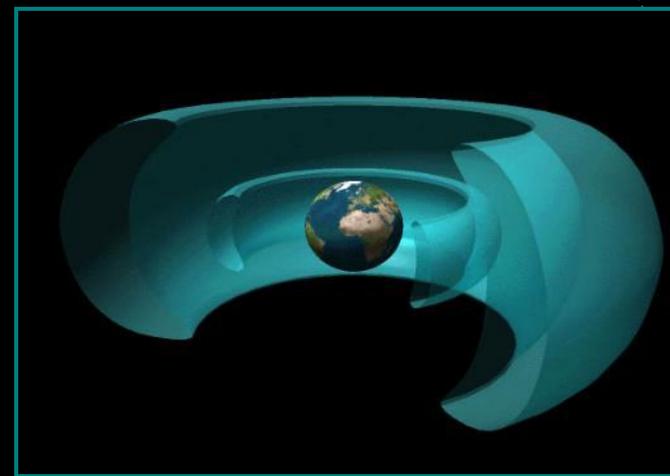
ENVIRONNEMENT
RADIATIF NATUREL



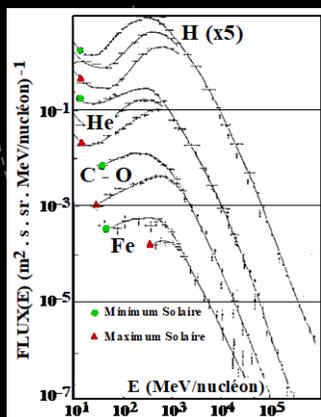
Rayons Cosmiques Galactiques



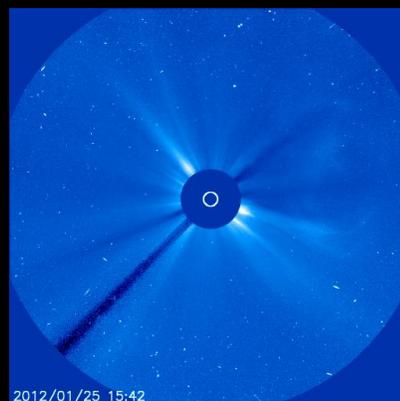
Soleil



Ceintures de Van Allen

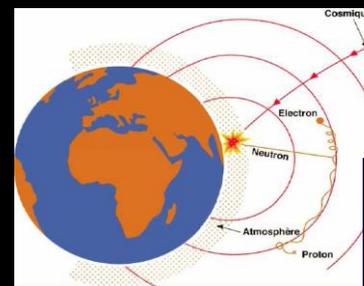


Ions lourds, protons
Très énergétiques
 $E_{max} > 10 \text{ GeV/u}$
Abondance
 $\text{max} \sim 300 \text{ MeV/u}$

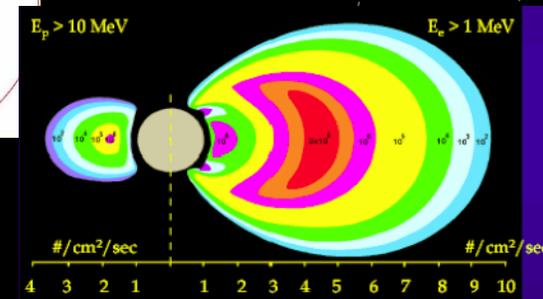


2012/01/25 15:42
© SOHO/ESA/NASA

Cycle solaire 11 ans
Vent solaire
Eruptions:
- CME (p+, ions)
- SEP (p+ rapides)

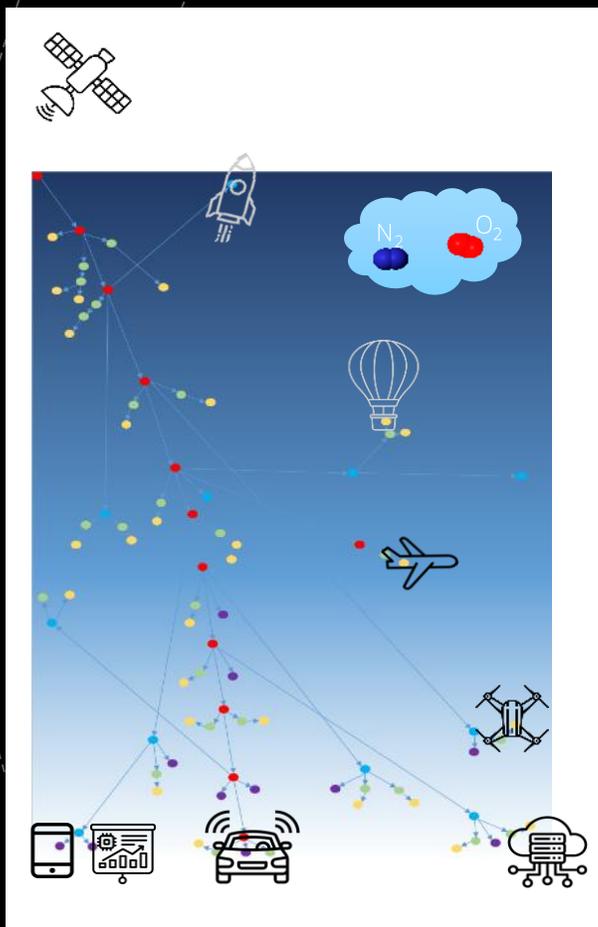


Protons et électrons piégés par
le champ magnétique terrestre



ENVIRONNEMENT RADIATIF ATMOSPHERIQUE

ENVIRONNEMENT
RADIATIF NATUREL



Interaction de protons avec l'atmosphère
Gerbes/cascades de particules secondaires
(protons, neutrons, muons, photons,...)

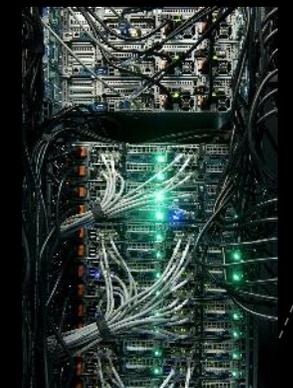
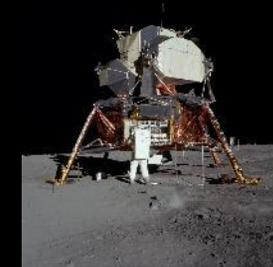
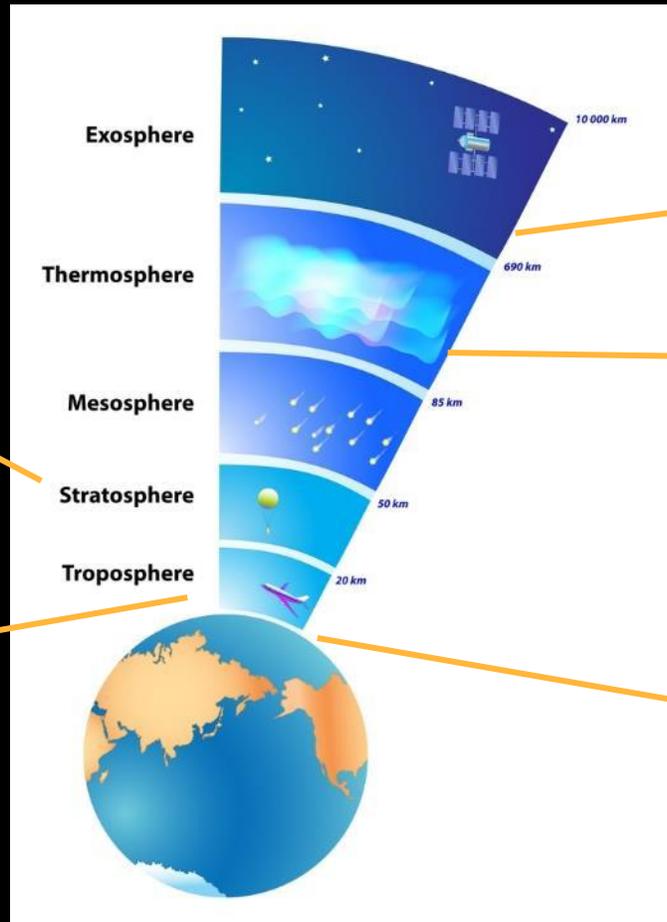


© ESA/NASA, 2016



ERN: TOUS CONCERNÉS

ENVIRONNEMENT
RADIATIF NATUREL



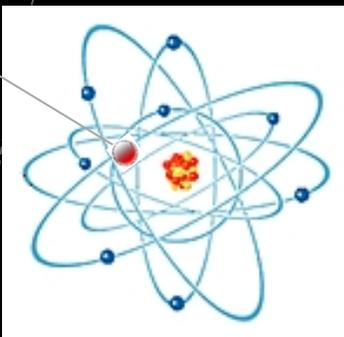
02

INTRODUCTION

INTERACTIONS RAYONNEMENT MATIÈRE

PERTE D'ÉNERGIE

INTERACTIONS
RAYONNEMENT
MATIERE



Par interaction avec

Le cortège électronique

(particules chargées)

- ⇒ Ionisation
 - ⇒ création de paires e-/trous

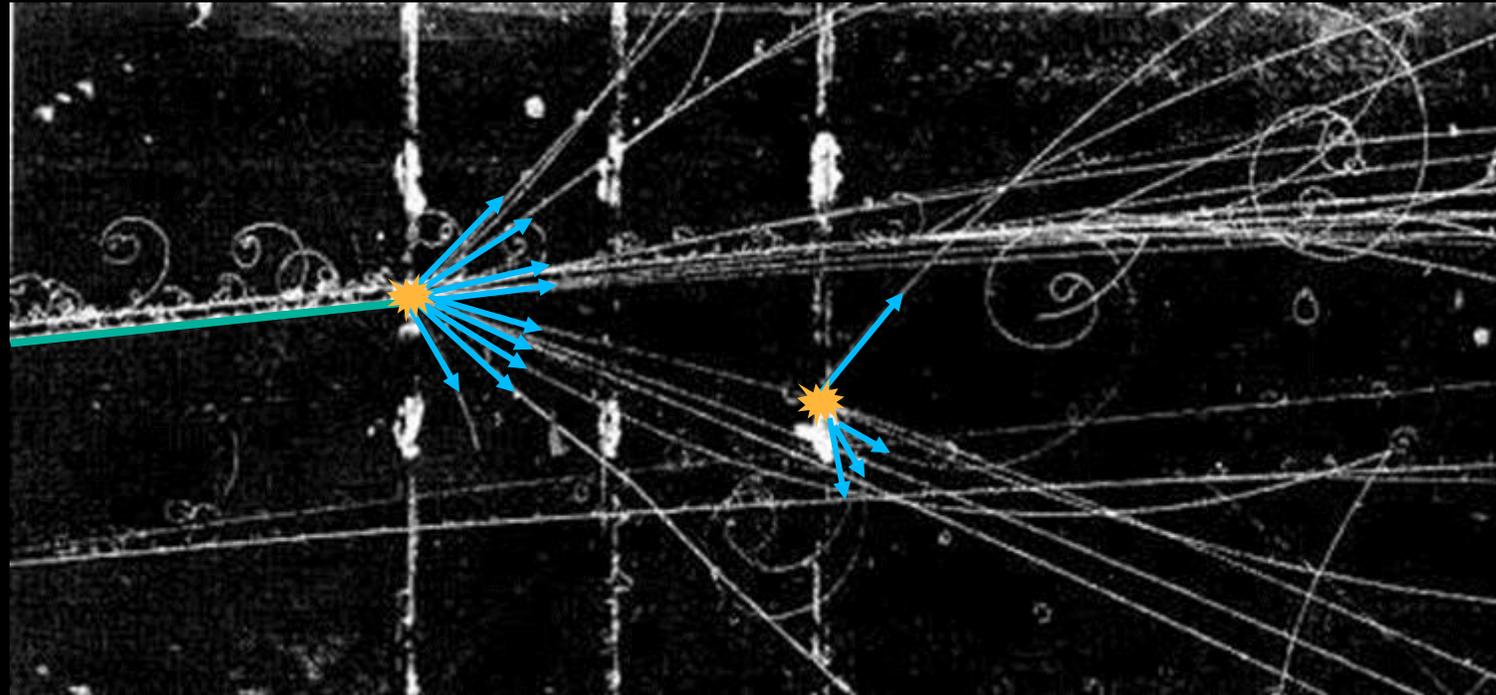
Le noyau

- ⇒ Interaction nucléaire
 - ⇒ Noyaux de recul, particules secondaires
 - ⇒ Défauts de déplacements
 - ⇒ Ionisation

ILLUSTRATION: CHAMBRE À BULLES

INTERACTIONS
RAYONNEMENT
MATIERE

Proton incident
→



Trace laissée dans une chambre à bulles par un proton de haute énergie

- Ionisation directe
- Interaction nucléaire et production de particules secondaires
- Particules secondaires et Ionisation indirecte

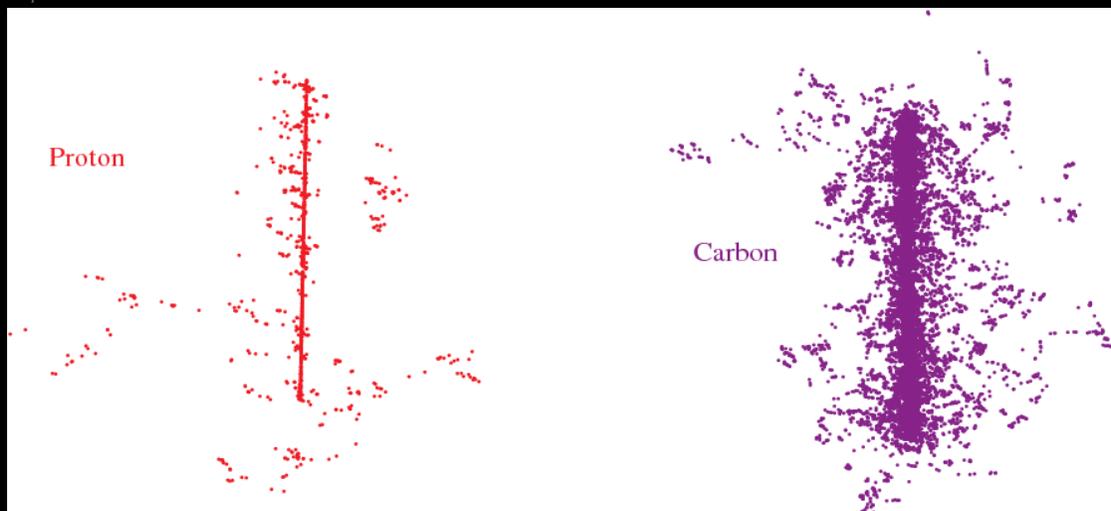
La chambre est soumise à un champ magnétique, les trajectoires des particules sont courbées vers la gauche ou la droite selon leur signe.

A partir de [Ionizing radiation detection and spectrometry, V. Ullmann](#)

LET: LINEAR ENERGY TRANSFERT

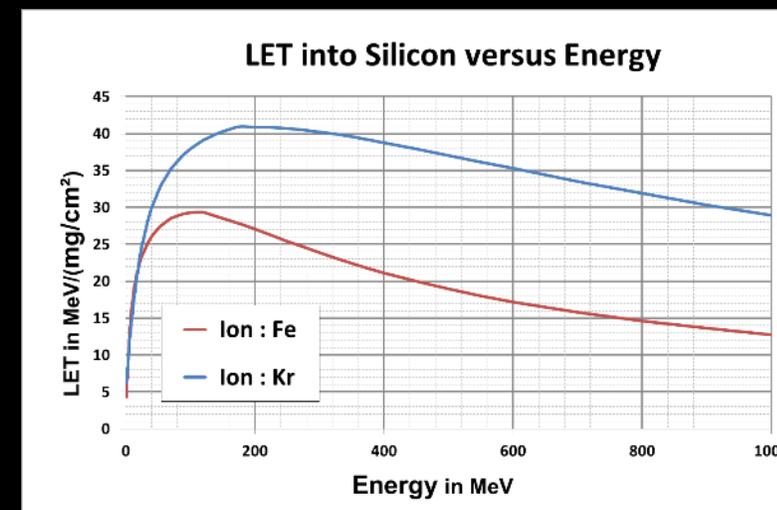
Energie déposée par ionisation le long de la trace

LET = f (p, Ep, Mat)



Dépôt d'énergie d'un proton et d'un ion Carbone dans 1µm d'épaisseur d'eau pour une énergie incidente de 1 MeV/n.

Bäckström, G. (2013). Protons, other Light Ions, and 60Co Photons : Study of Energy Deposit Clustering via Track Structure Simulations.



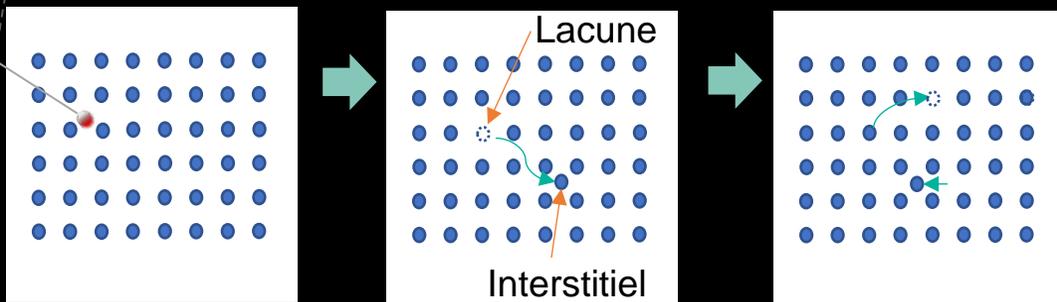
Variation du LET en fonction de l'énergie pour des ions de Fe ou de Kr dans une cible en Si

NIEL: NON IONIZING ENERGY LOSS

Energie déposée autrement que par ionisation

Interactions nucléaires – défauts de déplacements

Particule incidente

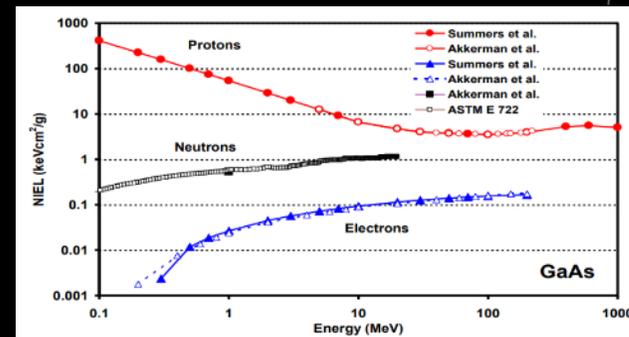
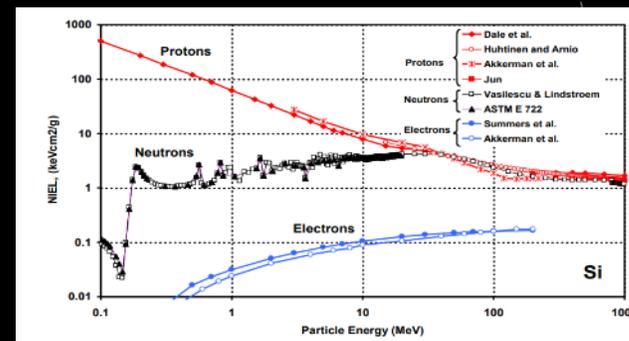


Création de défauts de déplacements
ou de clusters de défauts dans un réseau d'atomes

NIEL
Si

NIEL
AsGa

$$NIEL = f(p, E_p, Mat)$$



A. Jay et al., Simulation of Single Particle Displacement Damage in Silicon–Part II: Generation and Long-Time Relaxation of Damage Structure, IEEE-TNS vol;64 (2017)

C. Poivey, TNID Total Non Ionizing Dose or DD Displacement Damage, ESA- CERN SCC Workshop (2016)

03

EFFETS SUR L'ÉLECTRONIQUE

LES PHÉNOMÈNES CUMULATIFS

DÉFINITIONS

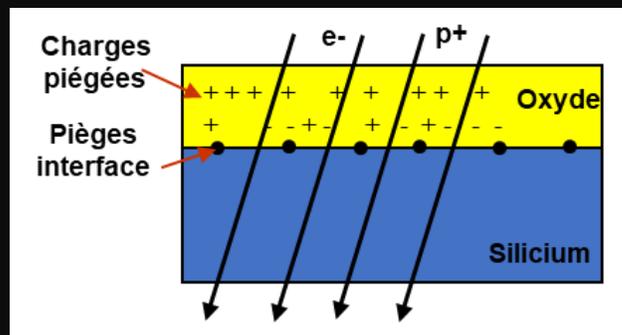
PHÉNOMÈNES
CUMULATIFS

Dose = Effet résultant de la contribution de nombreuses particules:

Dégradation progressive et vieillissement prématuré

Dose Ionisante: TID

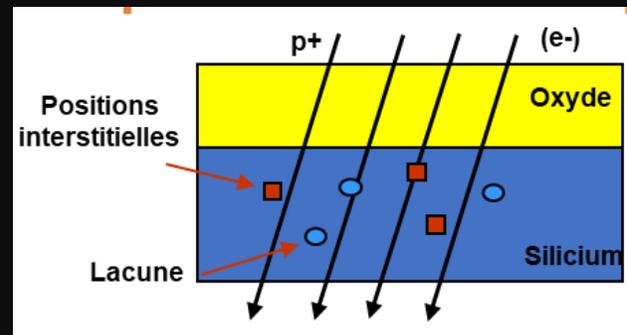
Total Ionizing Dose



⇒ Accumulation de charges dans les oxydes

Dose non Ionisante: TNID/DDD

Total Non Ionizing dose
/Displacement Damage Dose

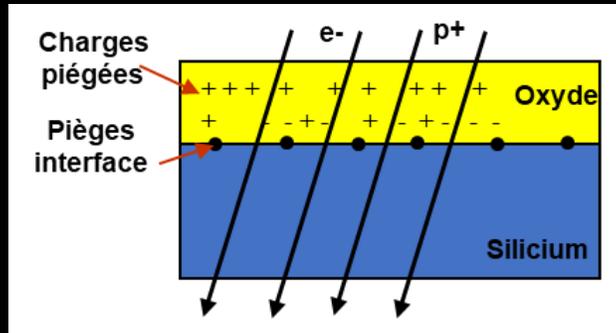


⇒ Apparition de défauts de déplacements dans les zones actives

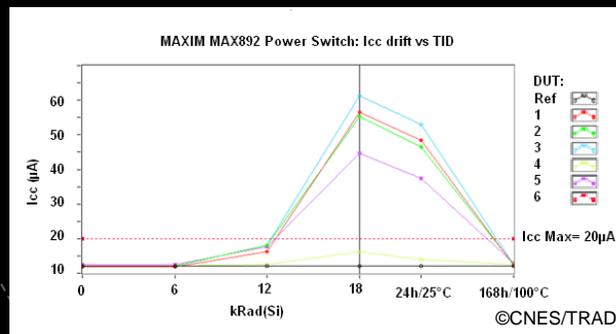
LA DOSE IONISANTE - TID

PHÉNOMÈNES
CUMULATIFS

Zone sensible: Oxydes



Composants sensibles:
Tous les composants actifs (plus ou moins)



Facteurs influents:

- Qualité des oxydes
- Epaisseur des oxydes
- Polarisation
- Température
- Débit de dose

Cinétique:

- Effets rapides
 - Création des paires e-/h dans le volume de l'oxyde
 - Séparation sous l'effet de \vec{E}
- Effet différé
 - Création d'états d'interfaces

Conséquences électriques:

- Variation de tension de seuil
- Apparition de courants de fuites

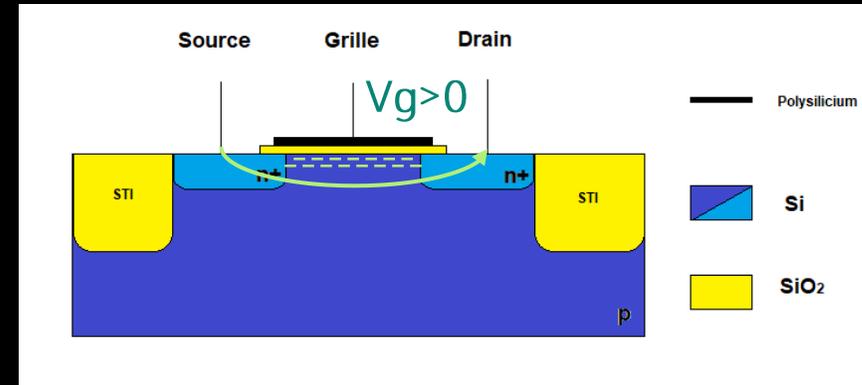
LA DOSE IONISANTE - TID

PHÉNOMÈNES
CUMULATIFS

Sensibilité suivant la technologie

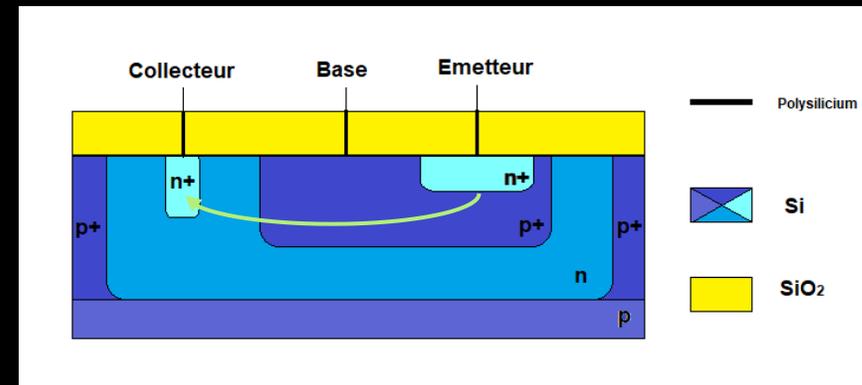
MOS et CMOS:

- NMOS plus sensible que PMOS
- Sensibilité ON > sensibilité OFF
- Courants de fuites
- Variation des tensions de seuil,
- délai de commutation



Bipolaire:

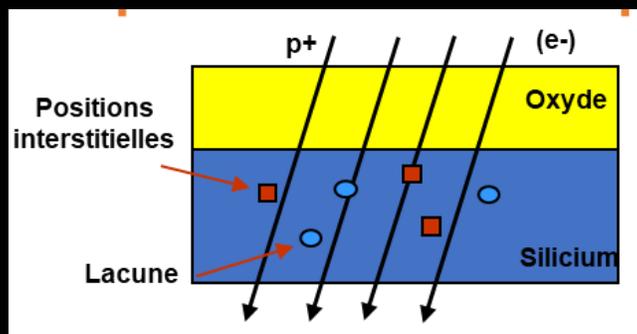
- N plus sensible que P
- Sensibilité OFF > Sensibilité ON
- Courants de fuites
- Variation des gains



LA DOSE NON IONISANTE - TNID/DDD

PHÉNOMÈNES
CUMULATIFS

Zone sensible: Substrat



Composants sensibles:

Bipolaires, Détecteurs,
Cellules solaires, LEDs,
Diodes laser, Optocoupleurs,
...

Facteurs influents:

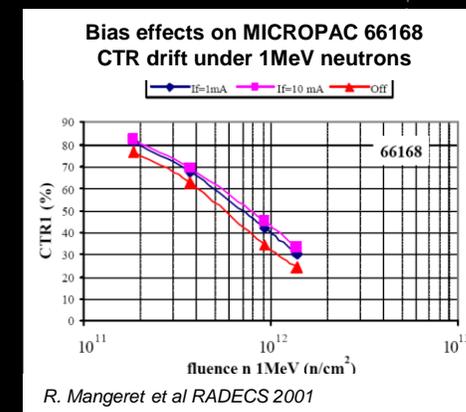
- Nature du substrat
- Qualité du substrat

Cinétique:

- Effets rapides
- Création des paires lacunes/interstitiels
- Effets différés
- Recombinaison possibles (fortes doses ~1 mois)

Symptômes:

- Variation des seuils
- Courants résiduels
- Perte de transmission
- Diminution des gains



04

EFFETS SUR L'ÉLECTRONIQUE

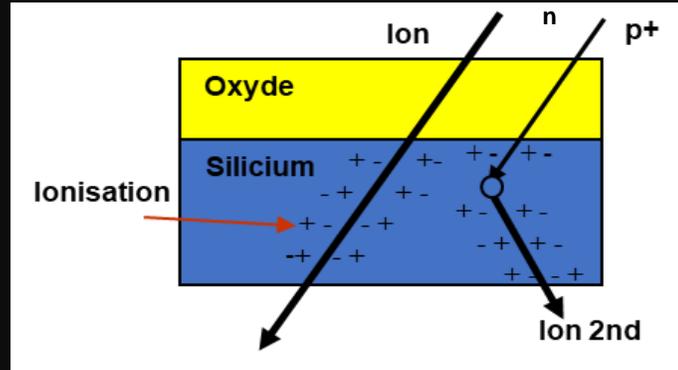
LES PHÉNOMÈNES SINGULIERS

SINGLE EVENT EFFECTS - SEE

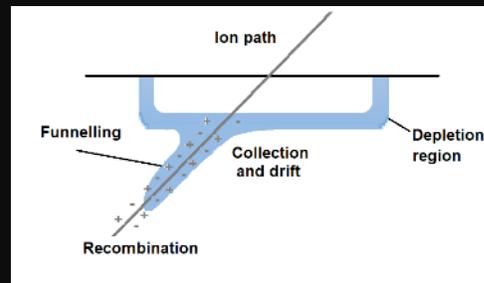
Effet résultant du passage d'une particule unique:

Effet immédiat, probabiliste

Par ionisation directe ou indirecte



⇒ Collection de charge dans les zones actives



Un SEE se produit si:

⇒ La charge q est déposée dans un nœud critique
⇒ Notion de **Volume Sensible**
(Zone de collection de charge)

Et

⇒ La charge est suffisante ($q > q_{\text{critique}}$)
⇒ Notion de **Charge critique**

On distingue plusieurs types de SEE:

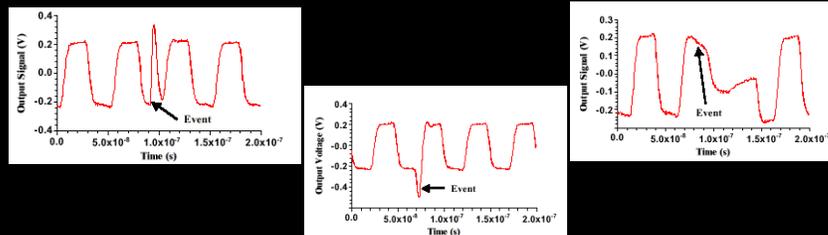
⇒ Destructifs (Hard Errors)
⇒ Non destructifs (Soft Errors)

LES SEE NON DESTRUCTIFS

LES EFFETS SINGULIERS

SET = Single Event Transient

- Changement d'état transitoire (qq 10 μ s)



SEU = Single Event Upset

- Mémorisation du transitoire dans une bascule
- Changement d'état logique
 - SBU: Single Bit Upset - Un seul bit dans le mot
 - MBU: Multiple Bit Upset – Plus d'un bit dans le même mot
 - MCU: Multiple Cell Upset – Plusieurs cellules touchées



SEFI = Single Event Functionnal Interrupt

- SET ou SEU conduisant à la perte de fonctionnalité



Sortie d'incident

SET = Rien à faire

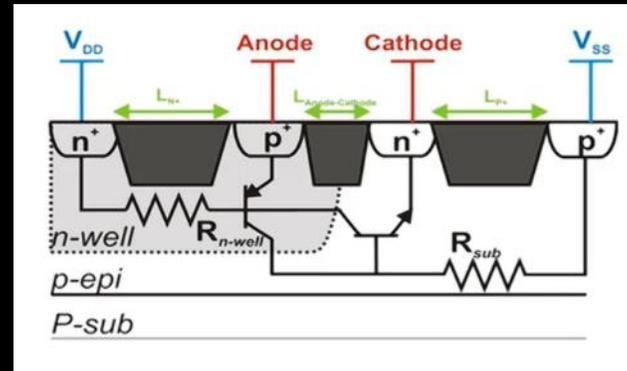
SEU = Ré-écriture

SEFI = Reset ou OFF/ON

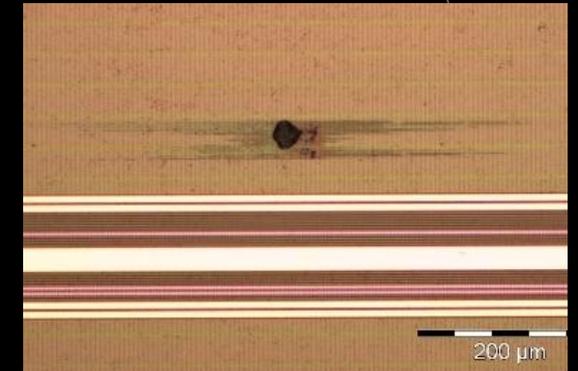
LES SEE DESTRUCTIFS

SEL = Single Event Latchup

- Mise en conduction d'une structure thyristor parasite
- Perte de fonctionnalité
- Seulement dans les composants CMOS (PNPN)
- Possible destruction par effet thermique
- Sensibilité augmente avec V et T°.
- Phénomène auto-entretenu
- Technologie et design dépendant



Extrait de Texas Instruments - Destructive SEE (Ti.com)



Point de fusion suite à des SELs répétés dans une mémoire SRAM BSI

Protections envisageables:

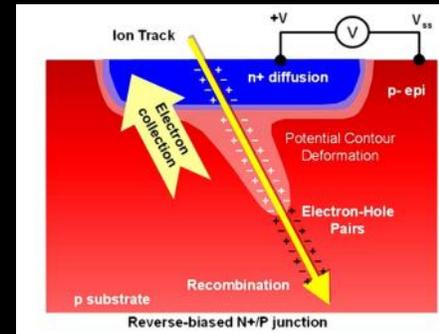
- **Délatcheur**: Limite le courant + cycle OFF/ON rapide => impact sur la fiabilité?
- **MAIS** dans certains cas le premier SEL sera systématiquement destructif

=> Un test sous faisceau permet d'écarter les composants non protégeables et, pour les autres, d'identifier la signature de SEL pour mettre en place une protection adaptée.

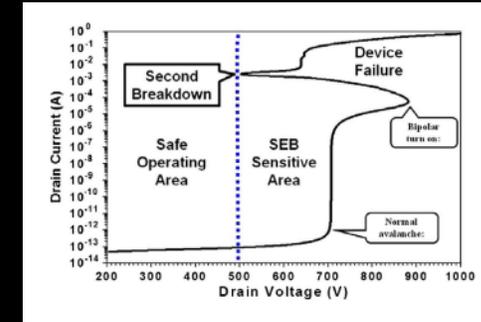
LES SEE DESTRUCTIFS

SEB = Single Event Burnout

- Conduction parasite, avalanche
- MOSFETs de puissance Canal N
- Possible destruction de l'oxyde
- Courant et tension dépendant.



Texas Instruments - Destructive SEE (Ti.com)



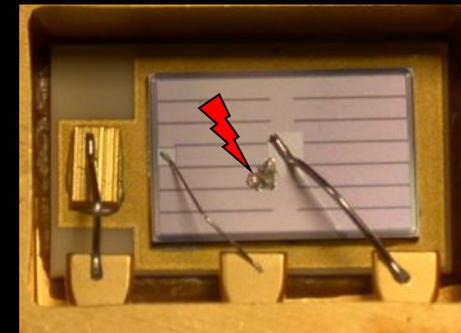
S. Liu et al., "Single-event burnout and avalanche characteristics of power DMOSFETs," IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 53, no. 6, pp. 3379–3385, Dec. 2006

SEGR = Single Event Gate Rupture

- Power MOSFETs en mode bloqué
- Défauts latents
- Destruction de l'oxyde de grille

SEDR = Single Event Diélectrique Rupture

- Idem dans composants numériques à grosses capacités (DRAMs)



Point de fusion suite à SEB dans un Power MOSFET canal N

Protections envisageables:

SEB et SEGR: Limiter la tension pour rester dans la Safe Operating Area (SOA).

MAIS AUSSI:

μ -SEL = Micro-Latchup

- SEL avec courant très limité (quelques mA max)
- Fonctionnalité parfois conservée
- Possible destruction par effet thermique très localisé
- Nécessite un OFF/ON

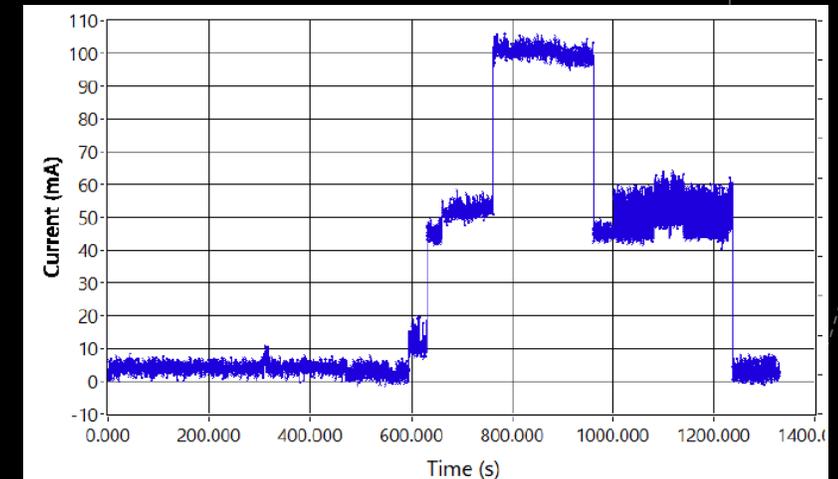
HCE = High Current Event

- Saut brutal de consommation, parfois réversible (RILC)
- Composants logiques complexes et mémoires
- Fonctionnalité parfois conservée
- A priori pas de destruction malgré les forts courants
- Nécessite un RESET et/ou un OFF/ON
- Impact sur la fiabilité ?

Protections envisageables:

- Très difficile à détecter => Pas de protection possible => impact sur la fiabilité?

- Un délatcheur sera efficace

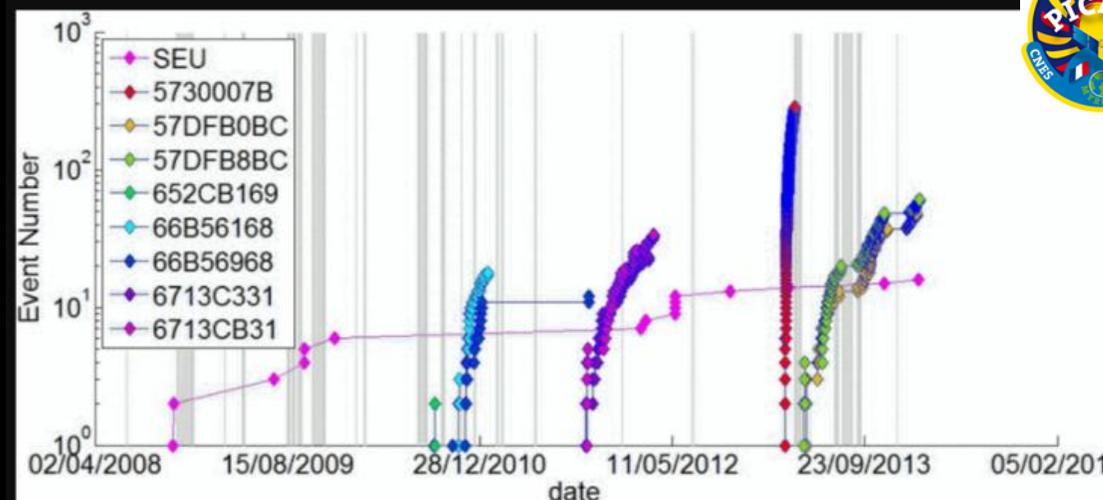


HCE sous ions lourds dans une mémoire Flash MICRON – Extrait de rapport de test TRAD

MAIS AUSSI:

SHE = Single Hard Error ou **ISB** = Intermittent Stuck Bit

- DRAM, SDRAM,
- Des bits deviennent incontrôlables
- Phénomène singulier qui peut être cumulatif et réversible
- Probable défaut local qui amène le composant en limite fonctionnelle (temps de rétention).
- Confirmé en vol – SSU du PICARD.



A. Samaras et al., "Experimental Characterization and In-Flight Observation of Weakened Cell in SDRAM," 2015 15th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS), Moscow, Russia, 2015, pp. 1-8, doi: 10.1109/RADECS.2015.7365611.

05

EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

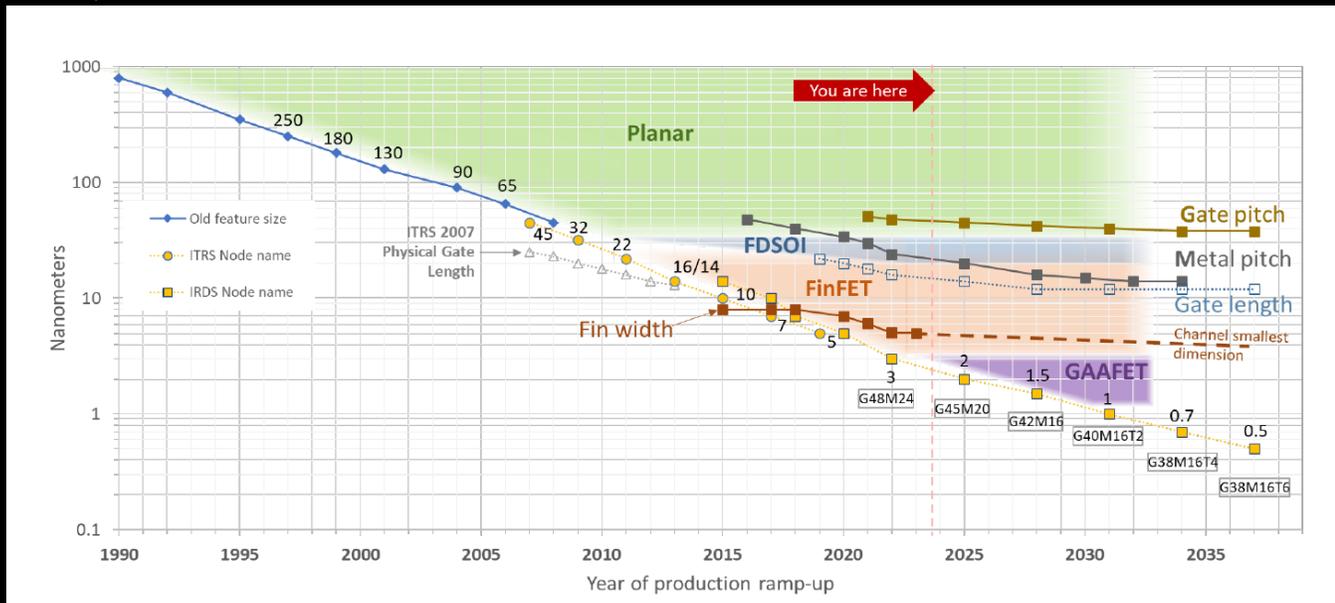
ET IMPACT SUR LA SENSIBILITÉ À L'ERN

COMPOSANTS CMOS

IMPACT DES
EVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

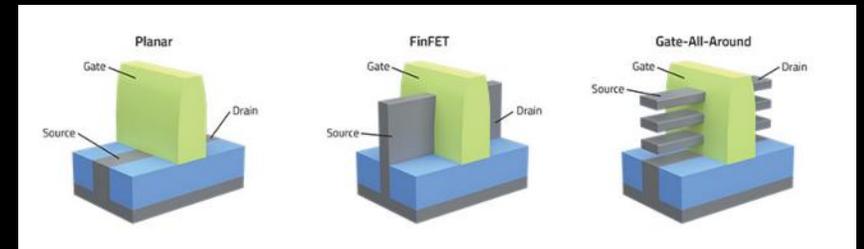
L'abandon des technologies Planar

La diminution d'échelle à rendu le passage au FinFET, puis GAAFET nécessaires.



Evolution de la taille du « nœud technologique » pour les technologies CMOS

V. Pouget, "Single Event Effects in Advances CMOS Technologies", RADECS2023 Short Course.



Lam Research Newsroom - Blog

Planar > FinFET > GAAFET:

- Meilleur contrôle électrostatique
- Moins de courants de fuites
- Consommation réduite
- Surface réduite

=> Pas de règle générale sur la sensibilité (TID ou SEE)

COMPOSANTS CMOS

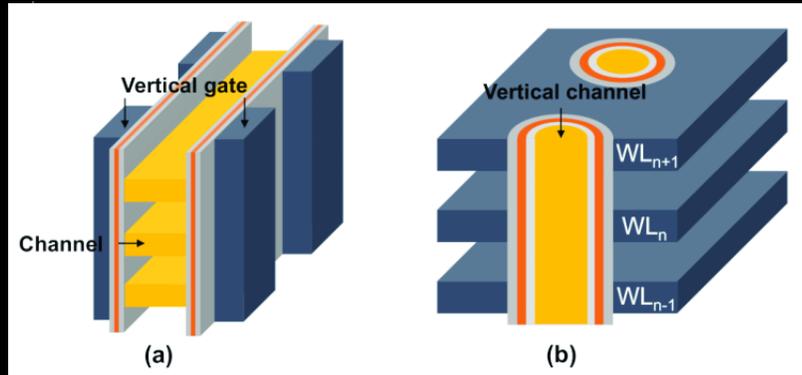
Emergence des technologies 3D

Mémoires Flash sont à l'origine de l'apparition des puces 3D en deçà de 10nm

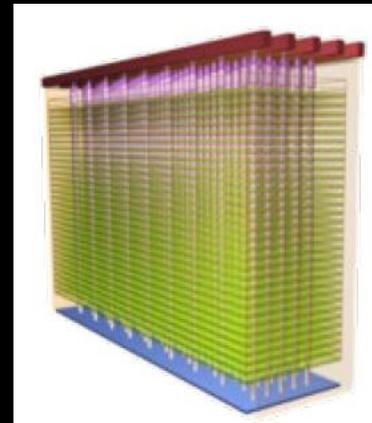
FG Floating Gate => MLC Multilayer cells

Effets de la densification:

- SEE multiples
- Effets d'angle (tilt/roll)
- Sensibles au RILC et ISB
- Synergie TID/SEE (LETseuil)



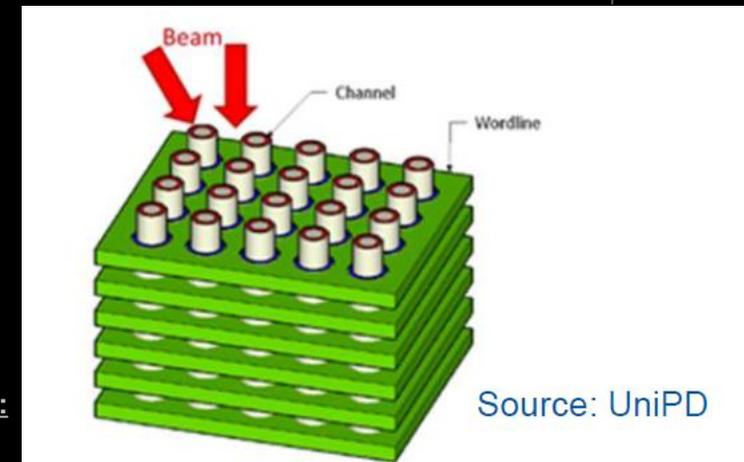
Schema de principe architecture 3D NAND : (a) grille verticale (b) Canal vertical



Etat de l'art en 2023: 3D NAND Flash 232 couches

Chiu, Yung-Yueh & Shirota, Riichiro. (2021). Technique for Profiling the Cycling-Induced Oxide Trapped Charge in NAND Flash Memories. Electronics. 10. 2492. 10.3390/electronics10202492.

M. Bagatin, Radiation Effects in Flash Memories: from Planar to 3D devices, SSQ2024



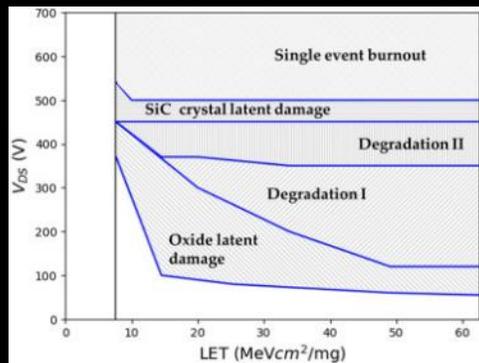
COMPOSANTS DE PUISSANCE:

SiC = sensible au SILC (Single Event Leakage Current)

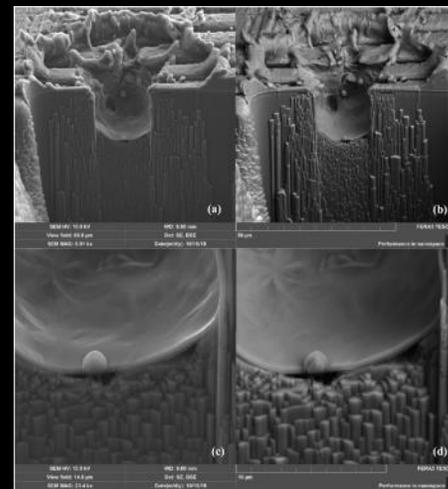
SiC Power Transistor

SEB et défauts latents comme pour les Power MOSFET

Dégradation des courants de drain et de grille (SILC) spécifique au SiC.



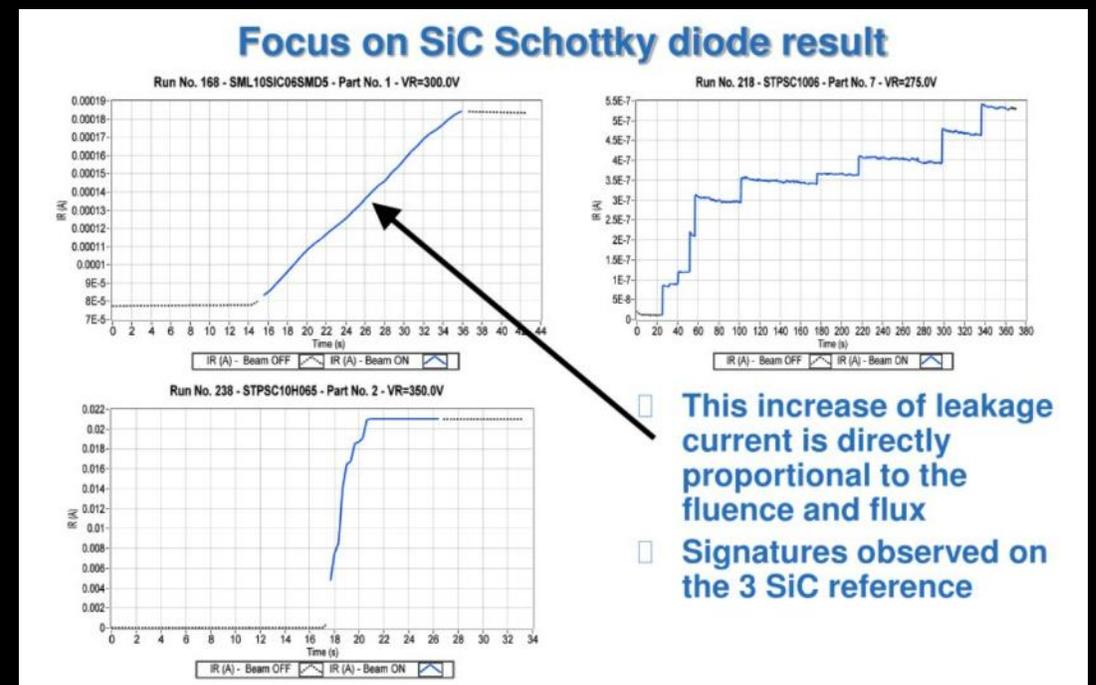
Different types of damages induced by heavy-ion SiC power MOSFETs as a function of the ion LET.



Cross-section of the damaged area after FIB milling.

C. Martinella et al., Heavy-ion induced single event effects and latent damages in SiC power MOSFETs, *Microelectronics Reliability*, Volume 128, 2022, 114423, ISSN 0026-2714, <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2021.114423>.

SiC Schottky diodes



P. Garcia et al. Single Event Burnout testing of high power Schottky diodes, *ESA/CNES Radiation Final Presentation days 2017*.

COMPOSANTS DE PUISSANCE:

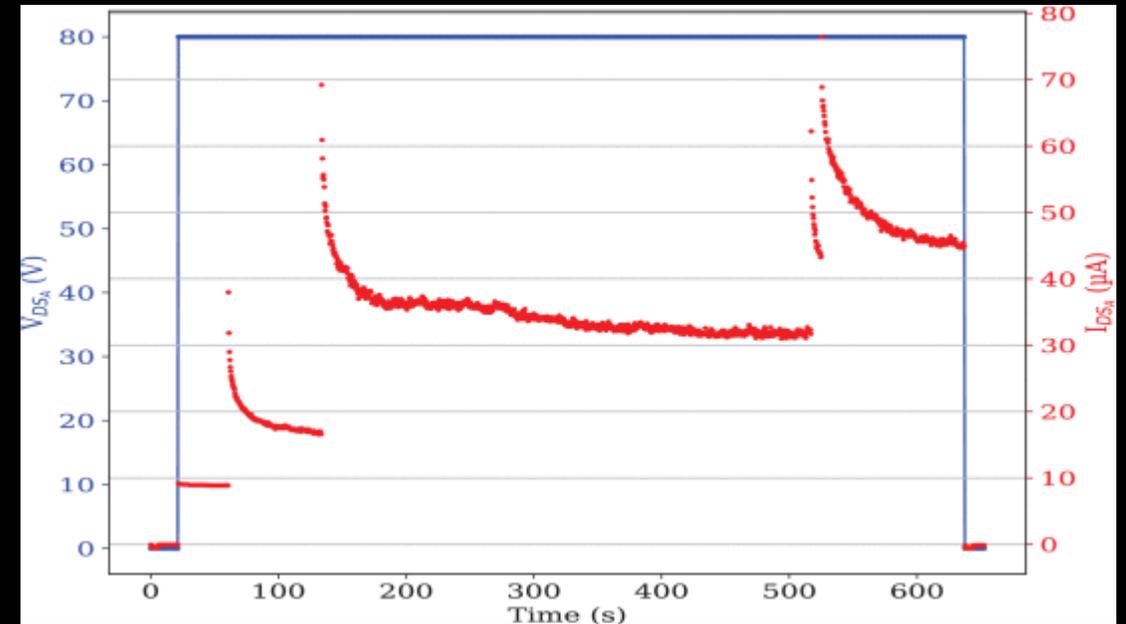
GaN SENSIBLE EN MODE BLOQUÉ

IMPACT DES
EVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

En mode bloqué, les GaN de puissance de tension élevée sont sensibles aux ions lourds de fort LET.

Ceux de plus basse tension sont plus robustes.

Part number	V _{DS} max (V)	Manufacturer	Ion	V Pass (V)	V Fail (V)
EPC2001C	100	EPC	Xe	100	-
EPC2012C	200	EPC	Xe	200	-
GS61008P	100	GaN System	Xe	90	-
PGA26E19I	600	Panasonic	Xe	300	350
PGA26E19I	600	Panasonic	Rh	350	375
IGOT40R07	400	Infineon	Xe	350	400
IGOT40R07	400	Infineon	Rh	375	375



V_{DS} and I_{DS} as a function of run time for GS61008T device using Xe at 995 MeV. Courtesy Alter Technology France.

J. -B. Sauveplane et al., "Heavy-Ion Testing Method and Results of Normally OFF GaN-Based High-Electron-Mobility Transistor," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 68, no. 10, pp. 2488-2495, Oct. 2021, doi: 10.1109/TNS.2021.3109990..

006

CONCLUSION

QUE REDOUTER ET COMMENT SÉLECTIONNER

EFFETS DE L'ERN SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES: QUE REDOUTER?

CONCLUSION

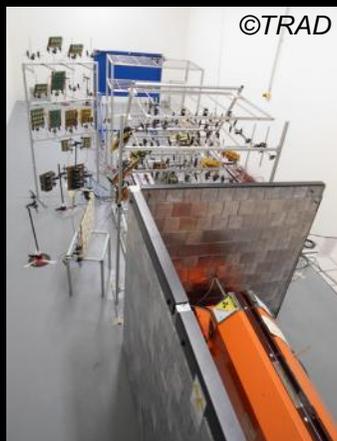
Type de rayonnement	TID	TNID	SEE
Ions lourds			+
Protons	+	+	+
Neutrons		+	+
Electrons	+		
Muons			+

	Espace	Ballons strato-sphériques	Aéronefs	Applications sol
Type d'effet	Niveau de risque			
TID	++			
TNID	++			
SEE	+++	+	++	+ / ++

LA SÉLECTION PASSE PAR DES ESSAIS: LES MOYENS D'ESSAIS

CONCLUSION

TID = Source de Cobalt 60



TNID = Accélérateurs de protons ou de neutrons



SEE = Accélérateurs d'ions lourds, de protons, de neutrons



NRTW 2025

National Reliability Technology Workshop

Mercredi 19 et Jeudi 20 mars 2025 | GANIL – Bd Henri Becquerel, 14000 Caen

merci pour votre écoute !

Organisé par :

